

< 日本特許・実用新案明細書収録セット >

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

ハードディスク用基板のメッキ方法

[公開編] 平成10年~平成12年(3年間) 59点

*電子BOOK版新登場! 全文PDF CD-ROM版 ￥20,900-
 全文紙収録 全文公報版 ￥20,900-

既刊関連セットのご案内

No,8497	公開特許	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点	¥27,800
No,8701(B)	"	透明導電膜形成用金属材料	平.9-10	62点	¥21,000
No,"(A)	"	"	平.7-8	56点	¥19,000
No,8868	"	半導体ウェハのメッキ方法と装置	平.5-11	103点	¥35,000
No,8963	"	フォトリソスト剥離剤の組成	平.5-11	76点	¥27,700
No,9010	"	透明導電膜形成用塗料の組成	平.9-11	55点	¥24,400
No,9064	"	溶射用金属材料と溶射方法	平.8-12	105点	¥40,000
No,8856	"	温純水乾燥方法と装置	平.5-11	118点	¥40,000
No,8812	"	電解剥離方法と浴の組成	平.5-11	105点	¥40,000
No,8639	"	液晶ガラスの保護膜形成法と組成物	平.5-10	95点	¥40,000
No,8632	"	透明導電膜のエッチング方法と浴の組成	平.5-10	89点	¥40,000
No,8631	"	ステンレス用酸洗剤の組成	平.5-10	73点	¥40,000
No,8494	"	ハードディスク研磨用組成物	平.5-9	61点	¥23,500
No,8508	"	磁気ディスク用ガラス基板の製造方法	平.7-9	53点	¥21,700
No,8496	"	ガラスへのメッキ処理方法	平.5-9	60点	¥23,700
No,8502	"	ガラスのウェット・エッチング方法	平.5-9	65点	¥24,800
No,8633	"	ステンレスの電解研磨加工法	平.5-10	73点	¥34,500
No,8641(B)	"	電気めっき用治具とめっき方法	平.8-10	90点	¥31,000
No,"(A)	"	"	平.5-7	91点	¥31,300
No,8826	登録・公開	メッキ剥離剤の組成と剥離方法	平.9-11	67点	¥24,800
No,8102	公告・公開	"	平.6-8	65点	¥23,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[原本コピーはB5サイズ・目次製本済みです。2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No. , CD-ROM版 ・ 全文公報版
所属部署	題 名
担当者名	合計 ¥
	() Fax ()
住所 〒	

ハードディスク用基板のメッキ方法 No,9214

[公開編]平成10年～平成12年 59点

CD-ROM版 ¥20,900

全文公報版 ¥20,900

日本特許公開平成10年

- 1 亜鉛置換処理液及び亜鉛置換処理方法
上村工業(株)
- 2 無電解ニッケルめっき液及び無電解ニッケルめっき方法
"
- 3 アルミへの亜鉛置換ニッケルメッキ方法
アルプス電気(株)
- 4 成膜用基板保持具およびこの保持具を用いた成膜方法、並びに、磁気記録媒体の製造用治具およびこの治具を用いた磁気記録媒体の製造方法
ホーヤ(株)
- 5 導体化膜形成方法
松下電器産業(株)
- 6 磁気ディスク及びその製造方法
(株)神戸製鋼所
- 7 カレンダー処理装置
ソニー(株)
- 8 成形用金型及びその製造方法
"
- 9 Al又はAl合金への無電解ニッケルめっき方法
三菱マテリアル(株)
- 10 磁気ディスク用支持体の製造方法
コヌグ Inc.
- 11 高融点材料から作られた、スパッタリングされた熱サイクル処理済み組織層
シーゲート Inc.
- 12 磁気記録媒体及びその製造方法
昭和電工(株)
- 13 " "

日本特許公開平成11年

- 14 磁気記録媒体用基板の製造方法
三菱化学(株)
- 15 " "
- 16 磁気ディスク用基板およびその製造方法
"
- 17 Ni系メッキ基板
(株)ワールドメタル
- 18 ハードディスクドライブケース用銅合金条
古河電工(株)
- 19 回転構造体及びそれを用いた関連製品
日本電産(株)
- 20 磁気ディスク用アルミニウム合金基板
日本軽金属(株)
- 21 シャフトの支持構造
淀川化成(株)
- 22 被めっき円板のめっき用ラック装置及びラック方法
日本軽金属(株)
- 23 めっき用仮置き円板およびアルミニウム円板のめっき方法
"
- 24 メッキ処理基板、磁気記録媒体およびこれらの製造方法
昭和電工(株)
- 25 直流モータ
松下電器産業(株)
- 26 スプレー・プロセッサを用いる金属膜の無電解めっき
エフエスアイ Corp.
- 27 被めっき板のめっき装置及びめっき方法
日本軽金属(株)
- 28 磁気記録媒体用基板および磁気記録媒体
三菱化学(株)
- 29 磁気記録媒体およびその製造方法
"
- 30 磁気記録媒体用基板、磁気記録媒体及びその製造方法
"

- 31 磁気記録媒体用基板の製造方法
三菱化学(株)
- 32 磁気ディスク基板およびその製造方法
昭和アルミニウム(株)
- 33 磁気ディスク基板の製造方法
"
- 34 " "
- 35 " "
- 35 " "
- 37 " "
- 38 ハードディスク基板の表面改質方法とその装置
エー・テクノロジー - LTD
- 39 磁気記録媒体のレーザテクスチャ加工方法
富士電機(株)
- 40 メッキ方法及び装置
富士通(株)
- 41 磁気記録媒体用基板のテクスチャ加工方法
三菱化成(株)
- 42 浅い条痕を有する磁気記録媒体およびその製造方法
和喬科技股分有限公司
- 43 磁気記録媒体の検鏡試料作製方法
富士電機(株)
- 44 磁気記録媒体のレーザ表面処理
シーゲート・テクノロジー - Inc.
- 45 ハードディスク及びその製造方法
スピードファーム(株)
- 46 めっき装置
日本軽金属(株)

日本特許公開平成12年

- 47 ハードディスク基板へのめっき方法
上村工業(株)
- 48 無電解ニッケルめっき方法及び装置
"
- 49 磁気ディスク用基板の製造方法
三菱化学(株)
- 50 磁気ディスク用ガラス基板への無電解Ni-Pめっき層の形成方法
富士電機(株)
- 51 磁気ディスク用基板の製造方法
昭和アルミニウム(株)
- 52 ボールの挿入装置および引抜装置
日本軽金属(株)
- 53 ラッキング装置及びアンラッキング装置
"
- 54 ディスク基板のめっき処理装置
三菱マテリアル(株)
- 55 磁気記録媒体およびその製造方法
富士電機(株)
- 56 無電解ニッケルめっき浴組成物およびそれを用いて形成された無電解ニッケル皮膜を有するめっき成形体
メルテックス(株)
- 57 磁気記録媒体及びその製造方法
東洋鋼板(株)
- 58 磁気クラディングを含む又は含まないセラミック - 金属マトリックス複合体から形成される磁気ディスク基板
アリン・Corp.
- 59 多重いずフォーカシングを利用するレーザ照射によって磁気記録媒体に集合組織を形成する方法
シーゲート・テクノロジー - Inc.

- 以上59点 -